

秋田県産業技術センター

施設・設備リスト

2025.04.01 企画事業部

秋田県産業技術センター 施設・設備利用のご案内

秋田県産業技術センターでは、試験研究、技術相談・指導、技術者育成、研究会活動、研修会・講習会の開催、技術情報の提供などの業務を行っております。県内企業をはじめとした来場者は、施設や設備機器を利用できます。

(1)利用者

どなたでもご利用いただけます。

(2)利用対象施設、設備機器および使用料

施設及び設備使用料に記載しているとおりです。

(3)利用日時

原則として、当センターの休業日を除く午前9時から午後5時までです。

(4)利用・申し込み方法

あらかじめホームページお問い合わせフォーム、Eメール、又は電話等で、対象設備、利用日時等をご連絡のうえ、当日まで申請手続きをお願いします。
使用が可能な場合は、許可証を交付します。

(5)使用方法

設備機器の使用方法については、必要に応じて当センター職員が指導します。

(6)支払い方法

当センターで発行する納入通知書により、指定金融機関に納付ください。

(7)ご利用にあたっての遵守事項

- ①会議室等の使用に際しての机、椅子の準備及び復旧は、使用者の責任において行ってください。
- ②茶器は無償で貸し出しますが、消耗品はお持ちいただき、後片付けは使用者の責任において行ってください。
- ③敷地内(駐車場・駐車中のお車の中を含む)は、全面禁煙です。
- ④設備機器のご利用にあたっては、原則として危険物及び有害物質の持ち込みを禁止します。
- ⑤当センターの施設及び設備機器をき損した場合は、直ちに届出願います。
故意又は過失によると認められる場合には、損害賠償の責任が生じますので、ご注意ください。

【申し込み・照会先】

秋田県産業技術センター

〒010-1623 秋田市新屋町字砂奴寄4番11

TEL 018-862-3414 (自動音声でご案内いたします)

FAX 018-865-3949

Home page <https://www.aitc.pref.akita.jp>

E-mail soudanshitu@aitc.pref.akita.jp

施設使用料および設備使用料

1. 開放研究室

(1) 本館

区 分	面積[m ²]	室数	使用料(円／月)
開放研究室 A	59	1	71,130
開放研究室 B	46	6	67,890
開放研究室 C	40	2	45,260

(2) 高度技術研究館

区 分	面積[m ²]	室数	使用料(円／月)
高機能開放研究室	61.44	5	99,630

2. 講堂・研修室・会議室・展示室

(1) 本館

区 分	収容人数 [人]	使用料(円)		
		9:00～12:00	13:00～17:00	9:00～17:00
講 堂	100	3,600	4,800	8,400
研修室 B	20	1,110	1,480	2,590
展示室	1,360(1 日)			

以下の付属備品は無料で利用できます。施設の使用申請の時に合わせてお申し込みください。

- ・ 液晶プロジェクタ、スクリーン、ホワイトボード、ワイヤレスマイク

(2) 高度技術研究館

区 分	収容人数 [人]	使用料(円)		
		9:00～12:00	13:00～17:00	9:00～17:00
視聴覚研修室	100	9,900	13,200	23,100
研修室 A	24	3,600	4,800	8,400

付属設備

区 分		使用単位	使用料(円)
視聴覚研修室	映像装置	一式 1 時間 につき	2,150
	同時通訳装置		1,620
研修室 A	拡声装置		530

3. 設備機器

次頁以降の一覧表をご参照ください。

(注1) 使用時間が1時間未満である時、または当該時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算した使用料となります。

(注2) 付属装置の設備使用料が追加される場合があります。

秋田県産業技術センター設備機器一覧

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
1	高周波3次元電磁界シュミレータ	アンソフト	HFSSV・10・1	H17	970	荒川
2	3次元電磁界最適化設計ツール	アンソフト・ジャパン	Optimetrics	H18	110	荒川
3	電磁界解析用ワークステーション	DELL	PrecisionT5400	H20	110	荒川
4	PC制御画像認識塗布システム	武蔵エンジニアリング	SHOTMASTER SM300DSS-3A+IMAGE MASTER 350PCSmart	H28	220	荒川
5	レーザーカッター	エピログ	Epilog Mini 24	H29	270	荒川
6	非接触ジェットディスペンサー	武蔵エンジニアリング	AeroJet	R02	100	荒川
7	低雑音振幅器	MITEQ	NSP2000-P	H17	110	丹
8	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	NF 3660	H04	440	丹
9	フォトレシーバ	NewFocus	1544-B-50	H22	110	丹
10	非接触三次元デジタイザー	Steinbichler	COMET	H21	1,990	黒沢（憲）
11	電源ノイズ測定器	TFF（テクトロニクス）	MD04104-6	H23	250	佐々木（大）
12	精密騒音計	リオン	NL-52	H25	100	内田（勝）
13	総合型金属顕微鏡	オリンパス	DSX500,DSX100	H25	540	内田（富）
14	超高精度三次元測定器	Panasonic	UA3P-300	H20	2,930	久住
15	非接触式フィゾー干渉計	Zygo	GPI XP/D	H19	580	久住
16	4インチ光学原器	Zygo	TS f/0.65, f/1.5, f/3.3	H21	300	久住
17	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	Zygo	フィゾー干渉計用球面測定ジグ	H23	140	久住
18	走査型白色干渉計	アメテック	NewView 9000	R06	2,000	久住
19	CNC3次元測定機	カールツァイス	PRISMO 5 HTG-S	H07	470	加藤
20	真円度測定機	ランクテラーホブソン	タリロンド262型	H08	110	加藤
21	CNC三次元測定機用データ処理装置	東京精密	Calypsoシステム	H18	850	加藤
22	超高倍率3次元複合顕微鏡	島津製作所	ナノサーチ顕微鏡SFT-3500ほか	H17	1,680	加藤
23	表面粗さ測定機	東京精密	サーフコム3000A-3DF-DX-S	H13	120	加藤
24	高精度CNC画像測定機	ニコンインステック	NEXIV VMZ-R6555	H27	800	加藤
25	デジタルマイクロスコープ	オリンパス	DSX1000	R04	700	黒沢（憲）
26	ハイエンド3次元CAD/CAMシステム	PTC	Creo	H10	110	内田（富）
27	3Dプリンターシステム	ストラタシス	FORTUS250mc	H25	1,120	内田（富）
28	3D鋳造積層造形装置	シーメット	SCM-10	H27	4,950	内田（富）
29	3次元CADシステム	DASSAULT SYSTEMS	Solidworks	H28	500	内田（富）
30	3次元X線CTシステム	東芝	TOSCANER-32300μFD	H28	2,850	内田（富）
31	鋳造CAEシステム	クオリカ	JSCAST	H29	580	内田（富）
32	ハイエンド3Dプリンターシステム	ストラタシス	J750	R01	8,850	内田（富）
33	3次元光造形システム	ストラタシス	ORIGIN ONE INDUSTRIAL	R05	5,940	内田（富）
34	3D形状計測システム	東京貿易テクノシステム	VMC7000M	R02	3,000	黒沢（憲）

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
35	再資源化焼結炉	アドバンテック東洋	KS-1703型	H07	160	遠田
36	管状炉	タナカテック	MPH-6VGS	H15	520	遠田
37	炭化賦活炉	WAVE21	炭化賦活炉 T-2000L	H16	1,210	遠田
38	ナノバブル評価装置	マイクロトラック・ベル	ZetaView-PMX100SP	H29	410	遠田
39	空圧落下衝撃試験装置	ボクスイ・ブラウン	SM-110-MP型	H03	110	伊藤
40	双腕型協働ロボット	川田工業	Nextage	R01	810	高橋
41	熱特性測定装置	NETZSCH	LFA457-A21 MicroFlash	H21	1,210	菅原
42	総合熱分析装置	セイコー電子工業	EXSTAR6000	H08	890	関根
43	電気伝導率・熱電率測定装置	真空理工	ZEM/PEM-1型	H09	1,410	関根
44	高温動弾性率測定装置	東芝タンガロイ	UMS-HL	H10	3,410	関根
45	ナノインデント	米国Hysitron	Model Triboscope他	H14	3,040	関根
46	熱膨張測定装置	理学電機	Thermo Plus 2	H15	470	関根
47	電子ブローブマイクロアナライザー	日本電子	JXA-8200ほか	H13	1,680	菅原
48	圧縮成形機	東洋精機	試験用加硫プレス 30tonf	S58	280	工藤（素）
49	真空加熱プレス装置	井元製作所	1824型	H19	110	工藤（素）
50	3D射出成形シミュレーション	富士通	CELSIUS W480-NTM	H23	1,150	工藤（素）
51	示差走査熱量計	日立ハイテクサイエンス	X-DSC7000	H23	630	工藤（素）
52	プラスチック万能材料試験機（CFRP用）	インストロン	5967型	H24	940	工藤（素）
53	メルトインテグサ	東洋精機製作所	型式G-01	H25	250	工藤（素）
54	自動プラスチック衝撃試験機	東洋精機製作所	IT	R04	250	野辺
55	電子天秤	ザルトリウス	MC210S	H10	110	工藤（素）
56	電子天秤	ザルトリウス	A200S	H10	100	工藤（素）
57	3次元CAD/CAMシステム	CNC Software	Mastercam他	H19	1,620	小松
58	色彩色差計	日本電色工業	SQ-2000	H12	290	工藤（素）
59	粘弾性測定装置	Anton Paar	MCR302	H26	1,120	工藤（素）
60	低高抵抗率測定システム	三菱アナリック	ロレスタMCP-T610,ハイレスタMCP-HT800	H26	210	野辺
61	プラスチック自動比重計	東洋精機製作所	DSG-1	H28	100	野辺
62	デジタル硬度計	テクロック	GSD-1	H29	100	野辺
63	熱分析装置	リガク	TG-DTA8122 / TMA8311(-S) / TMA8311(-H) / DSC8271 / DSCvesta	R02	1,120	関根
64	フーリエ変換赤外分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Nicolet iS50/iN10MX	R04	1,240	阿部
65	小型電気炉	セイシン企業	PART-3	H02	260	菅原
66	低温恒温水槽	小松エレクトロニクス	DW-621	H08	110	菅原
67	電動式塗工機	小平製作所	YOA-B型	H18	110	菅原
68	セミビッカース硬度計	マツザワ	PVT-7S	H21	430	関根
69	超硬製転動ミル用容器	伊藤製作所		H20	110	関根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
70	マイクロビッカーズ硬度計	マツザワ	AMT-X7FS-B	H28	270	関根
71	X線回折装置	リガク	RINT-2500	H09	720	菅原
72	高周波プラズマ発光分光分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	iCAP6300 Duo	H23	3,670	工藤（素）
73	蒸留水製造装置	アドバンテック東洋	RFD240ND	R04	100	工藤（素）
74	X線応力測定装置	マックサイエンス	MXP3AHP	H07	1,730	黒沢（憲）
75	スクラッチ試験機	新東科学	TYPE.22H	H06	400	黒沢（憲）
76	微小硬さ試験機	フィッシャー・インストルメンツ	H-100	H14	490	黒沢（憲）
77	X線残留応力測定装置	パルステック工業	m-X360s	R02	750	黒沢（憲）
78	ナノインデンテーション試験機	アントンパール・ジャパン	NHT3	R05	1,320	黒沢（憲）
79	低温灰化装置	ヤマト化学	PDC-210	H15	680	工藤（素）
80	電気マuffle炉	アドバンテック東洋	FUS612PA	H15	360	工藤（素）
81	ドラフトチャンバー	ダルトン	DFB11-DFC14,DFD31	H27	730	工藤（素）
82	CNC普通旋盤	TAKISAWA	TAC-510	R06	960	工藤（和）
83	ドリル研削盤	藤田製作所	DG36A形	S55	220	加藤
84	コンターマシン	アマダ	V-400	S47	110	加藤
85	直立ボール盤	吉田製作所	YUD600	S47	110	加藤
86	卓上ボール盤	吉田鉄工所	YBD-420B	S46	110	加藤
87	超精密成形形状研削盤	ナガセインテグレックス	SGC-630S4AK-Pcnc	H22	3,670	加藤
88	油圧式強力高速弓鋸盤	津根マシーンツール	PSB-350U	H12	280	加藤
89	ワイヤーカット放電加工機	ソディック	AQ360L	H18	1,010	加藤
90	5軸制御立形マシニングセンタ	オークマ	MU-400VⅡ型	H26	2,740	加藤
91	NCフライス盤	山崎技研	F-352	R03	1,280	加藤
92	細穴放電加工装置	ソディック	K1C	R04	730	関根
93	プラスチック粉碎機	ホーライ	VC3-360	H12	240	工藤（素）
94	エコーチップ硬さ試験機	プロセク（スイス）	D型	S60	130	内田（富）
95	鋳型焼成雰囲気炉	日新化熱工業	EBS-9（改）	H10	1,310	内田（富）
96	チタン用精密鋳造機	吉田キャスト	YSE-100	H28	1,270	内田（富）
97	複合サイクル腐食試験機	スガ試験機	CYP-90	R05	500	関根
98	マイクロフォーカスX線装置	日本フィリップス	HOMX-161	H05	1,830	黒沢（憲）
99	プレス付真空熱処理装置	東京真空	Press-VAC-2	H03	580	黒沢（憲）
100	交直両用TIG溶接機	ダイヘン	AVP-3000P	H13	740	黒沢（憲）
101	真空チャンバー	日本精機	φ500×H250mm（内寸）材質:SUS304	H14	280	黒沢（憲）
102	溶接部可視化装置	石川島播磨重工業	ILV型	H12	110	黒沢（憲）
103	レーザ加工装置	レーザライン	LDM3000-60	H29	1,900	黒沢（憲）
104	冷間等方加圧成形装置	アブライドパワー・ジャパン	CIP-50-2000	H07	310	関根
105	多目的高温炉	富士電波工業	ハイマルチ5000	H08	1,040	関根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
106	放電プラズマ焼結装置	住友石炭鉱業	SPS-2080	H08	5,400	関根
107	高速精密切断装置	平和テクニカ	HS-100G II	H29	300	関根
108	極間式磁気探傷機	日本工機	BY-1	S43	110	黒沢（憲）
109	超音波映像装置	日立エンジニアリング・アンド・サービス	FS200 II	H22	1,780	黒沢（憲）
110	磁気探傷機	島津製作所	PRA-80型	S46	230	黒沢（憲）
111	超音波探傷器	東京計器	SM80型	S53	510	黒沢（憲）
112	X線透過検査装置	理学電気工業	300EG-B2L型	S55	1,000	黒沢（憲）
113	JSNDI仕様デジタル超音波探傷器	GEインスペクション・テクノロジー・ジャパン	USM35X JE	H23	160	黒沢（憲）
114	有限要素解析用計算システム	エムエスシーソフトウェア	Marc2014AIT	H26	1,620	大竹
115	協働ロボット遠隔操作システム	ユニバーサルロボット／アスラテック	UR5e/V-Sido Webconnect	R02	540	大竹
116	ビッカース硬度計	アカシ	AVK-C2500	H04	110	内田（富）
117	微小硬度計	明石製作所	MLK-E型	S52	200	内田（富）
118	XY自動テーブル付硬度計	明石製作所	MS-4	S60	250	内田（富）
119	試料研磨琢磨機	丸本	DAP-2	S58	720	内田（富）
120	試料研磨琢磨機	ビューラー	エコメット4000	H20	720	内田（富）
121	電解研磨装置	ストルアス	ポレクトロール	H09	230	黒沢（憲）
122	セラミックス研磨装置	丸本ストラウス	アブラミン	H10	2,670	関根
123	セラミックス自動精密切断機	丸本ストラウス	アキュトム50	H11	400	関根
124	万能材料試験機	Instron	5985	H22	2,460	黒沢（憲）
125	3次元ひずみ解析システム	レーザー計測	VIC-3D	R03	2,000	黒沢（憲）
126	小型造粒機	日本アイリッヒ	アイリッヒ逆流式高速混合機RVO2型	H02	200	菅原
127	ボールミル	日陶科学	架台二連式AN-3S無段変速28～100bpm	H01	110	菅原
128	中型電気炉	モトヤマ	SH-3045E	H10	900	菅原
129	遊星回転ボールミル	伊藤製作所	LA-PO412	H08	210	関根
130	アトライタ	日本コークス工業	MAISE-X	H25	350	関根
131	真空乾燥用ミキサ	日本コークス工業	FMミキサ,FM10C/I-X型	H26	910	関根
132	真空溶解炉	富士電波工業	FVPM-10型	H07	1,890	内田（富）
133	ニューマブラスター	不二製作所	FDQ-4S	S57	300	内田（富）
134	動的ひずみ解析装置	共和電業	EDX-1500A-16AC	H10	110	内田（富）
135	エアブラストマシン	不二製作所	SGF-3(A)	R02	500	内田（富）
136	エアブラストマシン	不二製作所	SGF-3(A)	R02	500	内田（富）
137	発光分析装置	SPECTRO Analytical	SPECTROLAB M	H14	1,310	黒沢（憲）
138	シャルピ衝撃試験機	島津製作所	30kgm型	S54	140	内田（富）
139	万能試験機	島津製作所	UH-F300kNI	H19	700	黒沢（憲）
140	スガ摩耗試験機	スガ試験機	NUS-ISO-3型	H01	170	関根
141	摩耗試験機	エー・アンド・ディ	EFM-3-EM	H09	420	関根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
142	ベント式射出成形機	日精樹脂工業	NEX110-IV-12EG φ32ベント式可塑化ユニット	R02	1,780	野辺
143	プラスチックノッチ加工機	東洋精機製作所	A-4	R04	170	野辺
144	押出機	テクノベル	KZW25TW-60MG-NH(1200)スクリュ径25φ	H16	1,620	工藤（素）
145	集塵機	アマノ	PIE45	H18	490	工藤（素）
146	樹脂乾燥機	アドパンテック東洋	DRL823WA	H16	220	工藤（素）
147	標準試験片作製金型	日精樹脂工業	FP	R05	830	野辺
148	クリーンベンチ	日本エアーテック	BCM-843S-S	H16	100	久住
149	砥粒分散用超音波発生器	トミー精工	UD-201(S)	H13	110	久住
150	平坦度測定装置	ニデック	FT-900（ウェハ用）	H25	1,270	久住
151	磁束密度測定装置	F.W.BELL	9550	H09	130	丹
152	電界制御装置	トレック・ジャパン	MODEL20/20B	H10	110	久住
153	自動研磨ヘッド	ビューラー	オートメット2000 60-1970	H20	110	久住
154	除振台	明立精機	AYA-1809K4	H21	110	久住
155	レーザー変位計	キーエンス	LC-2400	H14	110	久住
156	電界砥粒制御用小型片面研磨装置	ビューラー	エコメット250/オートメット250	H28	160	久住
157	電界砥粒制御用多機能ワイヤーソー	タカトリ	WSD-K2	H30	1,010	久住
158	小型切削動力計	日本キスラー	9256C2	H16	500	工藤（和）
159	材料物性測定装置	東陽テクニカ	1260-MAS（ソーラートロン）	H18	700	田口
160	誘電率測定用サンプルホルダー	東陽テクニカ	SH2-Z	H25	100	田口
161	電源装置	トレックジャパン	MODEL609D-6	H07	190	久住
162	15MHzファンクションウェーブジェネレータ	日本ヒューレットパッカー	33120A	H11	110	久住
163	オシロスコープ	日本ヒューレットパッカー	HP-54645A	H11	110	久住
164	安全キャビネット	エアーテック	BHC-1006 II A/B3	H20	110	久住
165	核酸増幅システム	三洋電機バイオメディカ	MDF-192	H17	310	久住
166	蛍光顕微鏡	ニコン	E400-RFL 1	H15	200	久住
167	CCDカラーカメラ	東京電子	CS5270i-S	H12	110	久住
168	ゼータ電位測定装置	Sysmex	Nano Z	H19	340	久住
169	砥粒挙動モニタ用レンズ	モリテックス	ML-Z07545他	H12	110	久住
170	動的光散乱式測定装置	Malvern	ゼータナノサイザー ナノZSP	H26	810	久住
171	サーマルサイ클ー	Bio-Rad	T100	H27	100	久住
172	プレートリーダー	Bio-Rad	iMark PCシステム	H27	100	久住
173	蛍光式光ファイバー温度計	安立計器	FL-2000	H28	100	久住
174	フローサイトメーター	ベックマン・コールター	CytoFLEX 3レーザー13カラー	H28	1,220	久住
175	化学発光撮影装置	アトー	WSE-6100H LuminoGraph I	R05	100	久住
176	研磨装置	不二越機械工業	SLM-140	H22	490	久住
177	オシロスコープ	ソニーエレクトロニクス	TDS-420A	H05	100	久住

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
178	片面研磨装置	不二越機械工業	SLM-140改	H25	560	久住
179	熱電発電モジュール温度特性評価試験装置	サカタ理化学	MS-010	H24	520	菅原
180	減圧除湿乾燥機	カワタ	DV-30	H26	250	野辺
181	高速引張試験機	島津製作所	HITS-T10	H21	2,410	黒沢（憲）
182	落錘衝撃試験機	INSTRON	9205HV	H21	1,470	黒沢（憲）
183	材料試験高速解析システム	フォトロン	FASTCAM SA-X	H24	800	黒沢（憲）
184	立形マシニングセンタ用集塵防塵装置	アマノ	PiE-30SD	H22	780	加藤
185	立形マシニングセンタ	ファナック	α-T14iD	H16	470	加藤
186	複合材硬化成形用オートクレーブ	羽生田鉄工所	φ850×1500L	H21	1,470	藤嶋
187	複合材料切断機	丸東製作所	AC-300CF	H22	580	藤嶋
188	フラットベット切断機	ミマキエンジニアリング	CF2-1215RC-S	H25	760	藤嶋
189	複合材料圧縮成形装置	郷製作所	MBO05-GMS	H27	1,410	藤嶋
190	プラスチック耐候性試験機	スガ試験機	SX75	R06	2,540	阿部
191	プリント基板加工システム	日本LPKF	Protomat C100HF	H16	460	久住
192	ロボットシミュレーションシステム	シーエムエス	Visual Components 3D Automate	R01	730	大竹
193	バイポーラ電源	松定プレジジョン	POEF60-20	H27	100	丹
194	直流安定化電源	菊水電子工業	PAT80-100T WITH USB	H27	180	佐々木(大)
195	電子負荷装置	菊水電子	PLZ1004WH	H27	100	佐々木(大)
196	低温恒温高湿器	エスベック	PSL-2K	H19	240	佐々木(大)
197	雷サージ試験システム	ノイズ研究所	LSS-15AX-C1/S	H13	110	伊藤
198	耐候性試験機	岩崎電気	SUV-W161	H25	1,540	伊藤
199	グローワイヤー試験機	Physics tecincs Lab-topics	TA03.35（付属チャンバBT-07）	H25	320	伊藤
200	静電気試験器	ノイズ研究所	ESS-S3011A	H29	200	伊藤
201	冷熱衝撃装置	エスベック	TSA-73ES-W	R01	700	伊藤
202	超低温恒温恒湿器	エスベック	PSJ-2J	R05	400	伊藤
203	雑音総合評価試験機	ノイズ研究所	MODEL EMC-5000S	H01	890	佐々木（信）
204	ファストトランジェント/バースト試験機	ノイズ研究所	FNS-AX3-B50B	H26	150	佐々木（信）
205	衝撃波記録解析装置	Lansmont	Test Partner TP3-USB	H26	100	伊藤
206	複合環境試験装置	IMV	EM2502(1250/SA5M)（振動試験機本体）Syn-3HA-40（恒温恒湿槽）	H26	1,720	佐々木（信）
207	自動研磨装置	ビューラー	AUTOMET2 & ECOMET3	H09	170	遠田
208	スクラバー付ドラフトチャンバー	オリエンタル技研工業	GNE-1500N	H09	180	遠田
209	発熱量測定装置	島津製作所	CA-4PJ	H10	110	遠田
210	粉塵ドラフト	オリエンタル技研	GNS-1800S	H10	110	遠田
211	排ガス分析装置	島津製作所	GC-17A	H10	120	遠田
212	ガスクロ用オートインジェクター	島津製作所	AOC-20i	H16	110	遠田
213	GC用熱分解装置	島津製作所	PY-2020iD	H21	520	遠田

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
214	サイクロンサンプルミル	静岡精機	CSM-F1	H20	110	遠田
215	ハロゲン化合物測定自動前処理装置	三菱化学	AQF-100	H18	730	遠田
216	ビード作製装置	東京科学	TK-4100型	H16	810	遠田
217	ハンディ型燃焼排ガス分析計	テストー	t350システムXL	H23	130	遠田
218	粒度分布測定装置	日機装	MT3300EX2-SDC-H	H25	580	遠田
219	赤外線サーモグラフィカメラ	日本アビオニクス	R300SR-H	H26	100	遠田
220	ハロゲン化合物測定用検出器	Thermo SCIENTIFIC	ICS-1600	H26	410	遠田
221	ガス蒸気吸着量測定装置	日本ベル	BELSORP-max	H26	920	遠田
222	超純水製造装置	アドバンテック東洋	RFU665DA	H26	100	遠田
223	CHN元素分析装置	LECO	CHN628	R02	570	遠田
224	ガスクロマトグラフ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	8890GC+5977B	R03	1,610	遠田
225	低温恒温恒湿器	タバリエスベック	PL-3SP型	H05	180	遠田
226	イオンクロマトグラフ（陰イオン・陽イオン・糖分析システム）	ダイオネクス	ICS-3000+2100型	H22	1,570	遠田
227	吸着性能評価装置	Quantachrome	ChemBET-3000型	H16	700	遠田
228	バイオシェーカー	タイテック	BR-43FL-MR	H23	110	遠田
229	ふるい振とう器	タイテック	BR-43FL-MR	H23	100	遠田
230	分子量分布測定装置	島津製作所	ProminenceGPCシステム	H25	390	遠田
231	高感度ガスクロマトグラフ	島津製作所	Tracera	H27	470	遠田
232	粘度計	ブルックフィールド	DV2TCP	H29	100	遠田
233	表面張力計	協和界面科学	DY-500	H29	170	遠田
234	波長分散型X線装置	リガク	ZSX Primus IV	R01	1,170	遠田
235	紫外可視分光光度計	島津製作所	UV-3600i Plus	R03	420	阿部
236	揮発性有機化合物分析システム	日立ハイテクサイエンス	Chromaster	R06	1,010	阿部
237	微粉碎機	中央化工機	MB-1	H09	110	遠田
238	粗粉碎機	三田村理研工業	SR-2	H09	140	遠田
239	凍結粉碎器	日本分析工業	JFC-1500型	H15	300	遠田
240	小型タンデムリング粉碎機	中央化工機商事	TR-LM	H24	110	遠田
241	摂動方式誘電率測定システム	キーコム	摂動方式試料穴閉鎖形空洞共振器法比誘電率・誘電正接(ϵ_r , $\tan\delta$)測定システム	H18	310	千葉
242	ロックインアンプ	Anfatec Instruments	eLockIn205/2	H25	100	丹
243	差動プローブセット	ソニー・テクトロニクス	P6330・P5210・TCP202S	H14	110	佐々木（大）
244	計測制御ソフトウェア開発システム	National Instruments	LabVIEW 2010プロフェッショナル開発システム	H23	110	佐々木（大）
245	プレシジョンパワーアナライザ	横河電機	WT3000	H23	180	佐々木（大）
246	絶縁耐圧試験器	日置電機	3159	H14	110	伊藤
247	光テストシステム装置	横河電機	AQ2200	H17	710	佐々木（信）
248	ベクトルシグナルジェネレータ	アジレント	V2920A	H21	310	佐々木（信）

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
249	ミックスドシグナルオシロスコープ	日本テクトロニクス	MSO4104	H20	110	佐々木（信）
250	ソフトウェア品質評価試験システム	ハートランドデータ	DT10 STD Value IVセット	H26	260	佐々木（信）
251	ロックウェル硬さ試験機	アカシ	ATK-F1000	H07	190	内田（富）
252	放射線（α線,β線,γ線）測定器	日立アロカメディカル	TCS-362,TCS-172B,ICS-323C	H23	110	遠田
253	電子スピン共鳴測定装置	ブルカー・バイオスピン	EMXplus型（マイクロ波ブリッジ含）	H25	1,830	菅原
254	薄膜・粉末両用型高輝度X線回折装置	リガク	SmartLab9K-INP	H29	2,580	菅原
255	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日本電子	JSM-7900F	H30	5,490	菅原
256	イオンスパッタ装置	日本電子	JUC-5000	H04	2,040	岡田
257	実体顕微鏡	オリンパス	SZH-141	H04	350	岡田
258	卓上顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	Miniscope TM3030Plus,EDX:Quantax70	H27	770	田口
259	光電子分光装置（ESCA）	アルバックファイ	5600MC	H04	17,910	阿部
260	自動接触角計	協和界面科学	NMo-602	R05	600	阿部
261	紫外分光式磁気特性評価装置	ネオアーク	BH-M800UV-HD-10	H17	1,410	山根
262	クリーンブースA	日本エアテック	AER-2000C	H09	110	山根
263	ポータブル型分光測定装置	ARCopix S.A.	ARCspectro FT-NIR Rocket 0.9-2.6	H26	210	山根
264	モノクロメータ式分光光源	朝日分光	MAX-303+,CMS-100	H27	200	山根
265	偏光カメラ	ビットラン	4方向偏光子付きセンサー搭載501万画 素冷却CMOSカメラ	R04	100	山根
266	2次元光検出器	ビットラン	BQ-73LN	H22	120	笠松
267	ダイヤモンド研磨システム	マルトー	ML-150P	H05	110	岡田
268	低速切断機	サウスベイトテクノロジー	SBT650	H05	110	岡田
269	静電容量微小変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	H16	110	荒川
270	純水・超純水製造装置	アドバンテック	RFU655DA・RFP543RA	H22	240	田口
271	卓上プラズマエッチング装置	三友製作所	TP-50B	H27	470	伊勢
272	金属顕微鏡	ニコン	XPF-UNRB	H04	960	伊勢
273	ハイトゲージ	ハイデンハイン	CERTO-CT60M	H06	430	伊勢
274	静電式パターンニング装置	エンジニアリングシステム	QDX500-V-XC	H25	1,130	伊勢
275	ダイシング・ソー	ディスコ	DAD320	H07	1,470	内田（勝）
276	摩擦摩耗試験機	ブルカー・ジャパン	UMT-TL-BASE	R01	900	関根
277	パッチ式多元スパッタ装置	トッキ	SPM506	H07	3,820	山根
278	スパッタ機用RFマッチングボックス	トッキ	RF-MN750	H19	220	山根
279	イオンビームガン	アリオス	EMIS-212	H17	440	内田（勝）
280	スパッタリング用パルス電源	日本MKS	RPG-50A-00	H17	290	内田（勝）
281	イオンミリング装置	コモンウェルス	ミラトロンⅣ	H04	1,940	田口
282	クライオコンプレッサー	ブルックス・オートメーション	8200空冷式	H26	100	田口
283	パッチ式多層スパッタ装置	日電アネルバ	SPF-540H特	H04	2,570	伊勢
284	パッチ式スパッタ装置	日電アネルバ	SPF-332H	H06	2,040	伊勢

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
285	ディスクスリット装置	日本真空技術	SSH-4S	H05	12,570	山根
286	冷却水循環装置	オリオン	RKE3750B-V-G2	H28	230	山根
287	超高真空多元スリット装置	アルバック	MPS-4000-C6	H15	6,130	柴田
288	空冷インバーターチラー	オリオン機械	REK2200B1-V-G2	H25	120	山根
289	工場顕微鏡システム	ニコン	MM-11U	H04	2,990	伊勢
290	MEMS対応型マスクアライナ	ズース・マイクロテック	MA6BSA	H15	1,990	伊勢
291	マスクレス露光装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ	μMLA	R04	890	梁瀬
292	純水・超純水製造装置	日本ミリポア	Milli-Q Integral 10	H21	230	山根
293	超音波洗浄装置	本多電子	W118	H07	450	内田（勝）
294	サンプリングオシロスコープ	レクロイジャパン	9354TM	H07	160	黒澤（孝）
295	高速スペクトラムアナライザ	HP	E4401B	H11	280	黒澤（孝）
296	高速パルスジェネレータ	HP	HP81110A	H11	240	黒澤（孝）
297	ルビジウム周波数標準発振器	スタンフォードリサーチ	FS725	H17	110	黒澤（孝）
298	電波暗室・EMI測定システム	Rohde & Schwarz	ESIB26a	H16	9,740	黒澤（孝）
299	発振器	エヌエフ回路設計ブロック	WF1973	H19	110	黒澤（孝）
300	ロックインアンプ	エヌエフ回路設計ブロック	LI5640	H19	110	黒澤（孝）
301	低ノイズアンプ	TSJ	MLA-00118-B01-35	H20	110	黒澤（孝）
302	高利得マイクロ波アンテナ	Electro Metrics	EM-6969	H21	110	黒澤（孝）
303	自動車用直流電源インピーダンス安定化回路網	Schwarzbeck Mess Elektronik	NNBM8125	H21	110	黒澤（孝）
304	CISPR22対応電波吸収体	TDK	IS-030A	H22	110	黒澤（孝）
305	電磁シールド特性評価システム	テクノサイエンスジャパン	KEC法測定システム	H22	120	黒澤（孝）
306	雑音電力測定システム	東陽テクニカ	MAC600A-AJ, EPS/RFP-AJ	H25	100	黒澤（孝）
307	雑音測定用疑似通信回路網	協立電子工業	KNW-2208,KNW-441, F-51	H25	100	黒澤（孝）
308	電子負荷	計測技術研究所	LN-300A-G7	H26	100	黒澤（孝）
309	高周波発振器	アンリツ	MG3692C	H26	150	黒澤（孝）
310	EMC試験用交流安定化電源	エヌエフ回路設計ブロック	ES2000S+ES2000B×2台	H27	250	黒澤（孝）
311	放射・伝導イミューニティ試験システム	東陽テクニカ	IEC61000-4-3,IEC61000-4-6 2008対応	H27	1,400	黒澤（孝）
312	車載機器放射イミューニティ用アンテナ	東陽テクニカ	イミューニティ試験システム	H29	200	黒澤（孝）
313	オシロスコープ	キーサイト・テクノロジー	DSOX6004A	H30	140	黒澤（孝）
314	EMIレシーバー	ローデ・シュワルツ	ESW-26,TEPTO-DV/RE,TEPTO-DV/CE,TEPTO-DV/PE	H30	880	黒澤（孝）
315	EMS用発信器	ローデ・シュワルツ	SMB100B	R01	110	黒澤（孝）
316	電源周波数磁界イミューニティ試験装置	テクノサイエンスジャパン	IEC61000-4-8対応	R02	190	黒澤（孝）
317	ミリ波帯アンプ付アンテナ	テクノサイエンスジャパン	LB-180400Hほか	R03	100	黒澤（孝）
318	高分解能走査型プローブ顕微鏡	ブルカー・ジャパン	Dimension Icon	R02	2,000	久住
319	MTF評価装置（H21）	トライオプティクス	Image Master HR LP	H21	550	梁瀬
320	分光エリブソメータ	日本セミラボ	SE-2000	H28	1,130	山根

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
321	分光エリブソメータ用反射率測定モジュール	日本セミラボ	SE-2000用	H30	440	山根
322	触針式表面形状測定装置	アルバック	DEKTAK150	H21	250	阿部
323	MTF評価装置 (R03)	エフケー光学研究所	MATRIX-CS	R03	670	笠松
324	ナノ加工用イオンビーム装置	セイコーインスツルメンツ	SMI2050	H14	4,090	伊勢
325	クリーンブースB (H17導入)	日本エアーテック	ECB02-22D5	H17	130	伊勢
326	スペクトラムアナライザ	HP	HP4396B	H09	930	荒川
327	FFTサーボアナライザ	HP	HP35670A	H07	640	荒川
328	高周波連続可変フィルタ (H13導入)	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H13	110	荒川
329	FFTアナライザー	アジレントテクノロジー	35670A	H17	170	荒川
330	5ch静電容量変位計	ナノテックス	PS-Ⅲ-5D	H17	110	荒川
331	超高分解能光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ	BH20	H18	110	荒川
332	平面検出型光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ	BZ	H18	110	荒川
333	FFTアナライザー	小野測器	DS-2100	H19	220	荒川
334	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ	BH20	H20	110	荒川
335	ロジックアナライザ	アジレントテクノロジー	16804A	H20	240	荒川
336	オシロスコープ	アジレントテクノロジー	DSO7104A	H21	110	荒川
337	高分解能・光学スケール	ソニーマニュファクチャリングシステムズ	BH25,BD96-B1400HC特	H21	120	荒川
338	ファンクションジェネレータ (2ch出力)	テクトロニクス	AFG3252	H21	110	荒川
339	レーザ干渉変位計システム	小野測器	LV-2100	H21	130	荒川
340	除振台	明立精機	MAPS-008A-G1010	H22	270	荒川
341	走査型プローブ顕微鏡	エスアイアイ・ナノテクノロジー	L-trace II	H24	680	荒川
342	レーザドップラ振動計	小野測器	LV-1800	H25	140	荒川
343	微小トルク検出器	ユニパルス	UTM II -0.05Nm	H26	100	荒川
344	ピコメートル分解能非接触変位計	マグネスケール	BN100	H26	100	荒川
345	高分解能反射型レーザースケール	マグネスケール	BF1,BD-96	H26	100	荒川
346	差動型非接触振動計	小野測器	LV-1800	H26	150	荒川
347	デジタルオシロスコープ	キーサイトテクノロジー	DSOS104A	H29	230	荒川
348	マイクロスコープ	ハイロックス	KH-7700	H19	230	田口
349	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1157	H05	620	高橋
350	光マイクロメータ	MTI	MTI-2000 1165	H05	340	高橋
351	高分解能光ファイバー式変位計	フォトニクス	ATW-01+ATP-A20	H12	220	高橋
352	振動周波数分析器	エヌエフ回路設計ブロック	FRA5097	H25	130	高橋
353	小型赤外線サーモグラフィー	アビステ	FSV-210L	H30	170	高橋
354	オートコリメータ	ニコン	6B	H18	220	笠松

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
355	クリーンブースC（H17導入）	日本エアテック	ACB-352C-特型	H07	130	梁瀬
356	光学顕微鏡	ニコン	MM-11U	H07	590	梁瀬
357	GMR評価高磁界用マグネット電源	菊水電子工業	PBX20-20	H10	110	山根
358	発振器	HP	HP81110A	H11	240	黒澤（孝）
359	スポットUV照射装置	東芝ライテック	トスキュア250	H05	290	黒澤（孝）
360	ローパスフィルタ	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H09	440	黒澤（孝）
361	ロングメモリオシロスコープ	レクロイ	LC574AL	H11	680	黒澤（孝）
362	オシロスコープ	Agilent Technologies	54622A	H12	110	黒澤（孝）
363	スペクトラムアナライザ	Agilent Technologies	E4411B	H12	110	黒澤（孝）
364	磁気抵抗測定装置	ハヤマ	MRMS-10K	H20	3,770	黒澤（孝）
365	スイッチ・マトリックス	ケースレーインストルメンツ	4200-UL-LS-12	H21	110	黒澤（孝）
366	GPIB直流電源装置	菊水電子	PB×40-5	H05	260	黒澤（孝）
367	静電力発生用高圧電源システム	松定プレシジョン	HAR-30P73.3	H27	100	荒川
368	スポット溶接機	松下電器	YG501SPF	H05	300	丹
369	小型旋盤	エムコ	コンパクト8	H05	590	黒澤（孝）
370	立型帯鋸盤	ラクソー	VWS-55	H05	280	黒澤（孝）
371	ハイスピードマイクロスコープ	キーエンス	VW-9000	H28	400	笠松
372	電流アナライザ	キーサイト・テクノロジー	CX3324A	R04	3,500	丹
373	一軸面内磁場印加マニュアルプローバ	ハイソル	HMP-400SMS-Entry型	H27	350	黒澤（孝）
374	4ポートネットワークアナライザ	ローデ・シュワルツ	ZNB40/82	R03	1,120	黒澤（孝）
375	インピーダンスアナライザ	キーサイト・テクノロジー	E4991B	R05	1,010	黒澤（孝）
376	LCRメータ	HP	HP4284A	H07	610	荒川
377	アンプ付き電流プローブ	ソニーテクトロニクス	AM503S+op05	H11	110	黒澤（孝）
378	デジタルオシロスコープ	LeCroy	WR6051A	H16	110	黒澤（孝）
379	標準電圧電流発生器	アドバンテスト	R6161	H05	230	内田（勝）
380	マルチメータ	HP	HP3458A	H05	340	内田（勝）
381	ズーム顕微鏡	ユニオン光学	DZ2-SH	H09	230	笠松
382	大規模データ処理用並列分散計算クラスタリングシステム	IBM	eServer325	H16	150	黒澤（孝）
383	高周波連続可変フィルタ（H11導入）	エヌエフ回路設計ブロック	3660A	H11	180	木谷
384	フォトリソグラフ用クリーンオープン	榎本化成	CSO-402BF	H12	160	内田（勝）
385	スピンコータ	ミカサ	MS-A150	H21	140	内田（勝）
386	液晶配向シミュレータ	シンテック	LCD MASTER 3D	H18	190	梁瀬
387	ラビング装置	E.H.C	MR-100	H18	270	梁瀬
388	UV加圧硬化装置	E.H.C	MLP-320G	H19	110	梁瀬
389	アッペ屈折計	アタゴ	DR-M4/1550	H21	110	梁瀬
390	ヘッド観察用顕微鏡セット（ボアスコープ）	オリンパス	G080- 034-090-55	H05	110	梁瀬

No	名称等	製造元	仕様・品質等	購入年度 (S/H/R)	使用料 (円/時間)	担当者
391	照明光学系設計システム	Zemax	OpticStudio Professional版	H27	220	梁瀬
392	偏光顕微鏡	オリンパス光学工業	BHS-751-P型	S62	110	梁瀬
393	高性能LD光源	メレスグリオ	56RCS002/HV	H21	110	梁瀬
394	色彩輝度計	コニカミノルタ	分光フィッティング方式 CS-200	H25	130	梁瀬
395	可視光対応光スペクトラムアナライザー	横河計測	AQ6374-10-L1-D/FC/RFC	R02	340	梁瀬
396	高速カメラ	ディテクト	HAS-D3M	H25	110	笠松